SF-STAMP 光学系を用いた超高速 2 次元バーストイメージングの撮影時間窓拡大のための波

長掃引遅延パルス列生成光学系

Construction of spectrally sweeping delay pulses generation system for

time window expansion of ultrafast 2D-burst imaging method by

Sequentially Timed All-optical Mapping Photography utilizing Spectral Filtering (SF-STAMP)

根本 寛史 (B4), 鈴木 敬和 (D1), 肥田 遼平 (M2), 山口 勇輝 (M1)

Hirofumi Nemoto, Takakazu Suzuki, Ryohei Hida, Yuki Yamaguchi

Abstract

We generate a spectrally sweeping 100-ps-interval pulse train for ultrafast burst imaging. Adopting those pulses to sequentially timed all-optical mapping photography utilizing spectral filtering (SF-STAMP), we realize single-shot burst 5-frame imaging with a subnanosecond time window.

1. はじめに

従来の電子的高速カメラで撮影できる単発現象 は最短でナノ秒領域である.ナノ秒領域以下の高速 現象の撮影には、ポンプ・プローブ法による時間分 解計測が広く利用されているが,繰り返し計測が必 要であるため再現性に乏しい現象を撮影する場合 は適さない.この時間領域での単発撮影を実現する 手法として,線形周波数チャープ光パルスと光学的 フーリエ変換を応用した Sequentially timed alloptical mapping photography (STAMP) [1]がある. STAMP 法は、プローブ光として用いるチャープパ ルスの瞬時周波数に遅延時間を対応させることに 加え,画像情報をスペクトル帯毎に空間的に分解す ることで, チャープパルスの時間幅を計測時間窓と する時間分解能可変 2 次元高速バースト撮影を実 現している.オリジナルの STAMP では最大コマ撮 り枚数は 6 枚に制限されていたが、回折光学素子

(DOE) と波長選択バンドパスフィルタ (BPF) に よりスペクトラルイメージ分割を実現した STAMP utilizing spectral filtering (SF-STAMP) [2]により最大 25 枚の同時撮影が実現された [3]. しかし,分散媒 質の材料分散を利用する方法では,伸張できるパル スの時間幅に限界があり,現在までに達成されてい る SF-STAMP の撮影時間窓は最大で 70 ps 程度であ る.本研究では、SF-STAMP 法の時間窓を拡大する アプローチとして,近年, Time-stretch imaging の手 法に応用されている,回折格子とミラー対を用いて 自由空間での多重反射によりパルス幅の伸張を行 う光学系 Free-space angular-chirp-enhanced delay (FACED) [4]を構築し、中心波長の異なる遅延パル ス列を生成した. 我々は, 生成したパルス列を SF-STAMP の時空間イメージング方式に組み合わせる ことで,撮影時間窓を400psまで拡大し,ガラスの アブレーション過程をシングルショット撮影する ことに成功した.

2. FACED の原理

FACED を含む時間伸張光学系の全体図を Fig. 1 に示す.



Fig.1 Working principle of FACED

入射したレーザパルスは角度分散素子を通過した 後,波長ごとに異なる角度で1枚目のミラーに入射 する.2枚目のミラーは1枚目のミラーに対して完 全な平行からわずかに角度がずれた状態で配置さ れており,入射したパルスはミラー対を多重反射し た後,遠端側から抜けることなく,再び入射端に戻 り出射される.このとき,ミラー対での反射回数は 入射角に応じて変化し,入射角が大きなパルスほど 反射回数が多くなるため,FACED に入射したパル スは,ミラー間隔に対応する光路差を持ったパルス 列となって FACED から出射される.ただし,ミラ ー対での多重反射において往路と復路が完全に一 致するのは入射角 θが

$$\theta = k\alpha$$
 (kは整数) (1)

を満たす主光線と呼ばれるビームのみであり,それ 以外のビームはわずかに光路がずれた状態でミラ ーの入射端に戻り出射される.FACED で生成され るパルスの数 *M* は,ビームが 1 枚目のミラーに集 光する角度をΔθ,ミラー対が完全な平行から角度α だけずれているとすると,次のようになる.

$$M = \frac{\Delta\theta}{\alpha} \qquad (2)$$

また,隣接する 2 パルス間の時間間隔 τ は,光路 差から求められ,ミラー間隔 S,光速 cを用いて,

$$\tau = \frac{2S}{c} \qquad (3)$$

となる.また,時間間隔 τ のパルスが *M* 個得られ るので,伸張されたパルスのパルス幅は,

$$\Delta T_{total} = \tau \times M \qquad (4)$$

となる.以上から、ミラー対の角度ずれα、ミラー 間隔 *S* を変化させることでパルスの時間間隔やパ ルス幅を任意の値に設定することができる.ただし、 実際に伸張可能な時間幅はミラー対の長さによっ て物理的に制限を受けることに注意が必要である.

3. 波長掃引遅延パルス列生成

3.1. 波長掃引パルス列生成光学系の構築

本研究では、パルス列の各パラメータが以下の値 (中心波長: 795, 800, 805, 810, 815 nm, パルス間隔: 100 ps, パルス数: 5, 時間窓: 400 ps) になるように 波長掃引パルス列生成光学系の設計,構築を行った. 実際に構築した波長掃引遅延パルス列生成光学系 のセットアップを Fig. 2 に示す.



Fig. 2 Schematic setup of spectrally sweeping pulse train generating system

回折格子のブレーズ波長が805 nm になるように入

射角を決定し、各波長の回折角、シリンドリカルレ ンズの焦点距離からミラーへの集光角を計算する と、Δθ=1.64°となった.上記のパラメータを満たす ように、式(2)、(3)からα=0.328°、S=15 mm、と決 定した.なお、全ての波長のビームがミラー対で多 重反射を行うためには、全ての波長のビームで1枚 目のミラーへの入射角が0より大きくなる必要が ある.本実験では、回折中心波長805 nmのビーム の1枚目のミラーに対して入射角が6°になるよう にミラー対全体を傾けた.FACED入射前(CPA)パル スのスペクトルとFACEDから出射したパルスのス ペクトルをFig.3に示す.



Fig. 3 SC 光 pectrum of FACED input pulse and output pulse

FACED に入射する前のスペクトルが連続的であ るのに対し, FACED 出射のスペクトルでは, 波長 掃引パルス列の各パルスの中心波長に対応する 5 つの離散的なスペクトルのピークが計測される。な お, FACED 出射パルスのスペクトルは, 光軸方向 がわずかにずれているためピンホールを用いて主 光線のみを測定したものである.

3.2. 波長掃引パルス列の時間特性

CPA システムから出射したフェムト秒超短光パルスから, FACED によって一定間隔の遅延時間を

有するパルス列が生成されていることを確認する ため,和周波発生を利用してパルス間隔を評価した. Fig. 4 に和周波発生に用いたセットアップを示す.



Fig. 4 Schematic setup of sum frequency generation to characterize the temporal profile of the pulse train.

あらかじめビームスプリッタで光路を分けた CPA システム出射パルスと FACED 出射パルスで 和周波発生を行い、ディレイラインの光路長を変え ながら和周波が発生する位置と箇所を調べること で、パルスの数を確認した.得られた和周波のスペ クトルを Fig. 5 に示す.



Fig. 5 Spectrum of sum frequency generation

Fig. 5 に示すスペクトル①~⑤は異なる 5 つのデ ィレイラインの位置で計測されたものであり、これ により、5 つのパルスが生成されていることが確認 できた.なお、和周波のスペクトル①~⑤は、Fig. 3 に示したスペクトルのピーク①~⑤をそれぞれ 中心波長とするパルスによって発生されたもので ある.また,そのときのディレイラインの光路長差 から FACED 出射パルスのパルス間隔を計算する と,パルス間隔は 100 ps であった.

4. SF-STAMP 光学系によるシングルショッ

ト2次元バーストイメージング

4.1. SF-STAMP 光学系の構築

本研究で構築した顕微光学系, SF-STAMP 光学系 のセットアップを Fig. 6 に示す.



Fig. 6 Schematic setup of SF-STAMP system

SF-STAMP による 5 枚同時バースト撮影を実現す るため、25 ビーム分岐 DOE (HOLOEYE, customized model), 大口径冷却 CCD (BITLAN, BU-55LN)を使 用した. 受光面のサイズは 24.0 mm × 36.1 mm, ピ クセルサイズは 7.4 μm×7.4 μm, 総ピクセル数は 4872 × 3248 である. サンプルの情報を含んだ波長 掃引パルス列は、顕微光学系によって 20 倍までイ メージが拡大された後, SF-STAMP 光学系の1枚目 のレンズ (f=50 mm) を伝搬し, DOE により 5×5 = 25 個のアレイビームに複製され、中心波長 830 nm, スペクトル幅 2.2 nm (FWHM) の BPF (IRIDIAN, ZX000167) で波長選択された後,2枚目 のレンズ (f = 50 mm) により冷却 CCD の受光面上 の異なる位置に結像する. 波長掃引パルス列を照明 光として用いた, SF-STAMP 光学系によるマルチス ペクトラルイメージングの結果を Fig.7 に示す. 使 用した対物レンズは, OLYMPUS 社製, LMPLFLN20x (×20, NA = 0.40, WD = 12.0)で ある.



Fig. 7 A multispectral image captured by SF-STAMP system with spectrally sweeping pulse train

Fig. 7 のマルチスペクトラルイメージの内,波長を 示した 5 つのイメージが波長掃引パルス列の各パ ルスに対応しており,これらをシングルショットイ メージングのフレームとして用いた. なお,それ以 外のフレームのイメージでは時間情報が重複して いる,あるいは1つのイメージに異なる時間の情報 が含まれているため,本実験の構成においては意味 を持たない.

4.2. シングルショットバーストイメージング

SF-STAMP によるシングルショットイメージン グの実験セットアップを Fig. 8 に示す.



Fig. 8 Experimental setup of single-shot imaging by SF-STAMP

光源にはモードロック Ti:Sapphire レーザをチャー プパルス増幅器 (CPA) により増幅したフェムト 秒レーザパルス (中心波長 805 nm, スペクトル幅 20 nm, パルス幅 50 fs, 平均出力パワー 1.0 W, 繰 り返し周波数 1kHz) を用いた. CPA から出射され た FTL パルスを BBO 結晶に入射させ,発生した2 倍波をポンプ光として使用した.一方, BBO 結晶 で2倍波に変換されずに透過したパルスを FACED へ入射させ,生成した波長掃引パルス列を偏光ビー ムスプリッタとλ/4 板を利用して取り出し、プロー ブ光として用いた.なお、シングルショット撮影の ために光学チョッパおよびシャッターをポンプ光 とプローブ光に分離する手前に用いて単パルスを 切り出した. SF-STAMP を用いて, 薄膜ガラス (厚 さ 50 µm) 表面にポンプ光を集光させ、ガラス表面 のアブレーション過程のシングルショット 5 コマ 超高速撮影を行った.プローブ光には FACED で生 成した5つの波長掃引パルス列を用い、100 psのフ レーム間隔で、撮影時間窓 400 ps にわたる計測を 行った. Fig.9 にガラス表面におけるアブレーショ ン過程のシングルショット撮影をした結果を示す. なお,結果に示した画像はいずれも変化前との差分 を取り、コントラストを調整したものである. Fig. 9では、ポンプ集光後からアブレーションプルーム が時間とともに大きく膨らんでいく様子が 100 ps のフレーム間隔で 400 ps にわたって観測され、撮 影時間窓の拡大が実現された.

5. 今後の展望

本研究では、ミラーの長さによる物理的な制限と イメージングに使用した光源の帯域による制限か ら、実現された連写枚数は5枚であるが、SF-STAMP を用いたシングルショットイメージング では最大連写撮影枚数は 25 枚が実現されている. 波長掃引パルス列を照明光として使用する手法で は,生成されるパルスの数が実現可能な連射枚数に 対応するが、本研究では、FACED に用いたミラー の長さが25発のパルスを生成する上で十分でない ため、パルス数5発、計測時間窓 400 ps に留まっ ている. 今後は, SF-STAMP の性能を最大限発揮 するため、さらに長く(>15 cm)、高反射率なミラー 対を FACED に使用し, 光源を中空ファイバで発生 させた広帯域パルス(40 nm~)に変えることで,最大 連写枚数を大幅に増加し,同時に計測時間窓のさら なる拡大も可能になる. FACED のパラメータの 例として、Δθ=2.24°、α=0.089°、S=15 mm とする ことで25フレームでのシングルショット撮影が達 成される.また、本研究で構築した、波長掃引パル ス列生成システムのフレーム間隔や計測時間窓の 可変性をさらに活かすことで、様々な時間スケール において再現性の乏しい単発現象を解明していく ことが期待される.



Fig. 9 Measured images of ablation on glass in a single shot by SF-STAMP with spectrally sweeping

pulse train

6. まとめ

本研究では、自由空間内におけるミラー対の多重 反射を利用して時間伸張を行う FACED を、シング ルショット超高速 2 次元バーストイメージング手 法である SF-STAMP に組み合わせることによって、 撮影時間窓を 400 ps まで拡大することに成功した. 今後は、さらに広帯域な光源と長いミラーを組み合 わせることで、生成できるパルスの数を増やし、25 フレームのシングルショット撮影を可能にし、撮影 時間窓を数ナノ秒まで拡大することを目標とする.

References

- K. Nakagawa, A. Iwasaki, Y. Oishi, R. Horisaki, A. Tsukamoto, A. Nakamura, K. Hirosawa, H. Liao, T. Ushida, K. Goda, F. Kannari, and I. Sakuma, "Sequentially timed all-optical mapping photography (STAMP)," Nat. Photonics 8, 695–700 (2014).
- T. Suzuki, F. Isa, L. Fujii, K. Hirosawa, K. Nakagawa, K. Goda, I. Sakuma, and F. Kannari, "Sequentially timed all-optical mapping photography (STAMP) utilizing spectral filtering," Opt. Express 23, 30512 (2015).
- T. Suzuki, R. Hida, Y. Yamaguchi, K. Nakagawa, T. Saiki, and F. Kannari, "Single-shot 25-frame burst imaging of ultrafast phase transition of Ge₂Sb₂Te₅ with a sub-picosecond resolution," Appl. Phys. Express 10, 92502 (2017).
- J.-L. Wu, Y.-Q. Xu, J.-J. Xu, X.-M. Wei, A. C. Chan, A. H. Tang, A. K. Lau, B. M. Chung, H. Cheung Shum, E. Y. Lam, K. K. Wong, and K. K. Tsia, "Ultrafast laser-scanning time-stretch imaging

at visible wavelengths," Light Sci. Appl. 6, e16196 (2017).